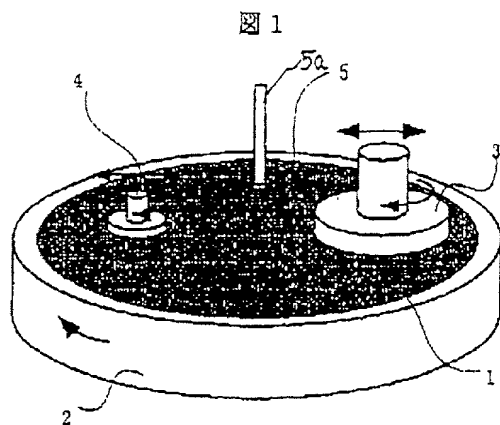
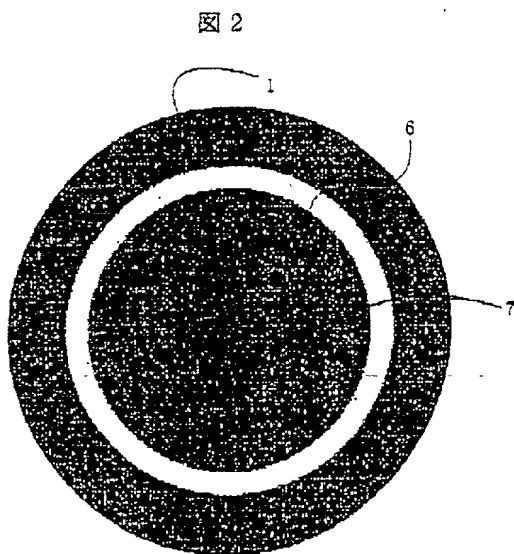


【書類名】 図面

【図 1】

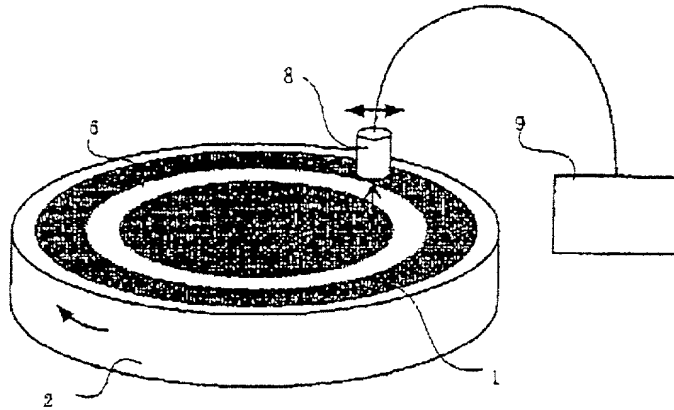


【図 2】



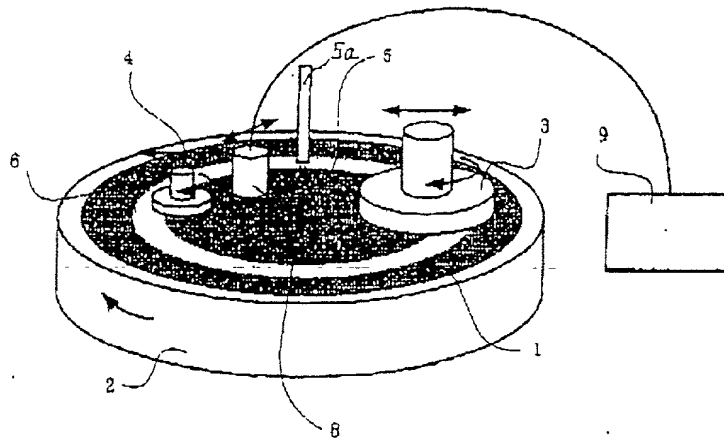
【図 3】

図 3

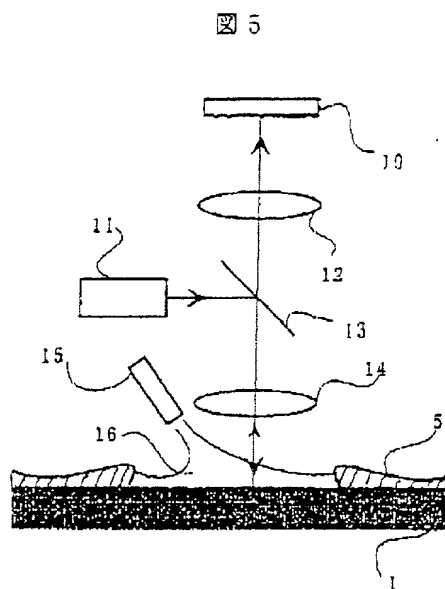


【図 4】

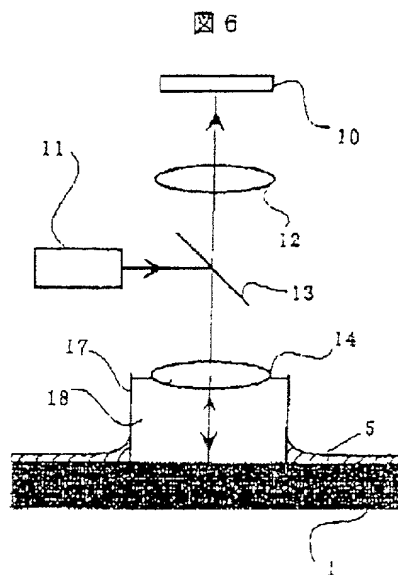
図 4



【図 5】

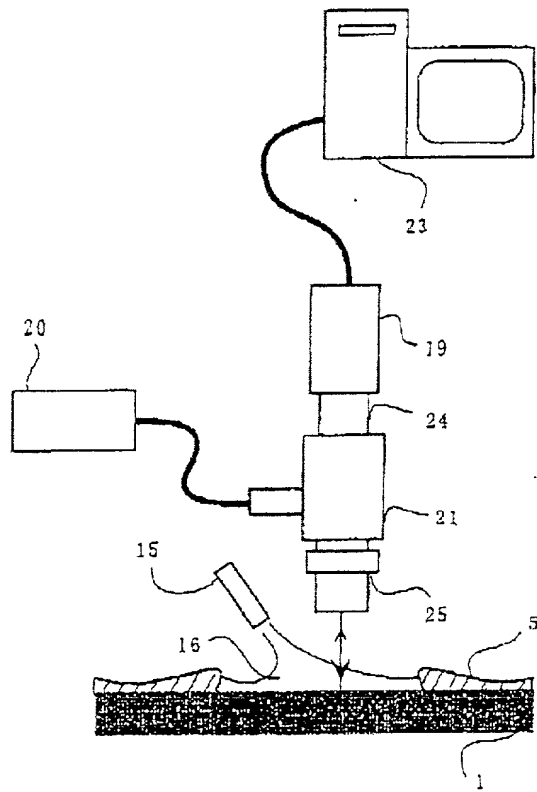


【図 6】

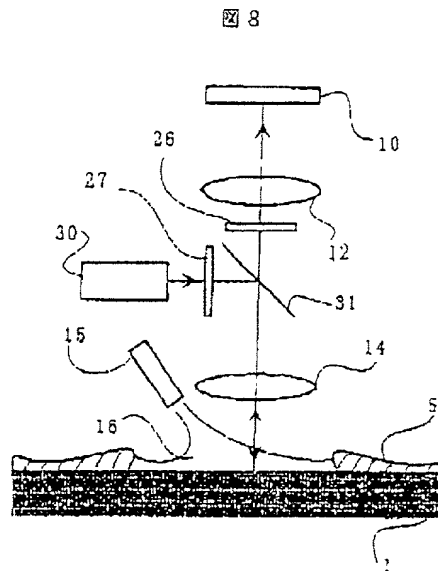


【図 7】

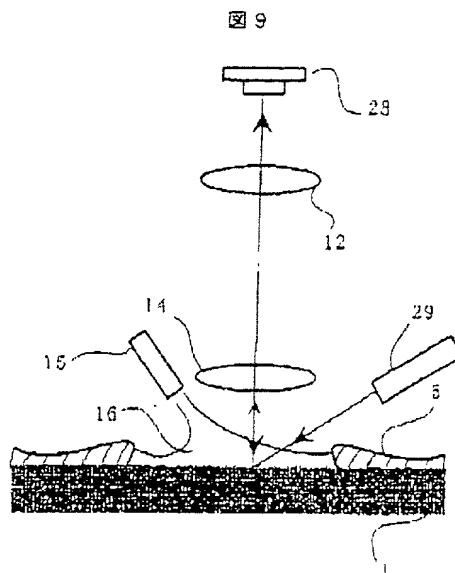
図 7



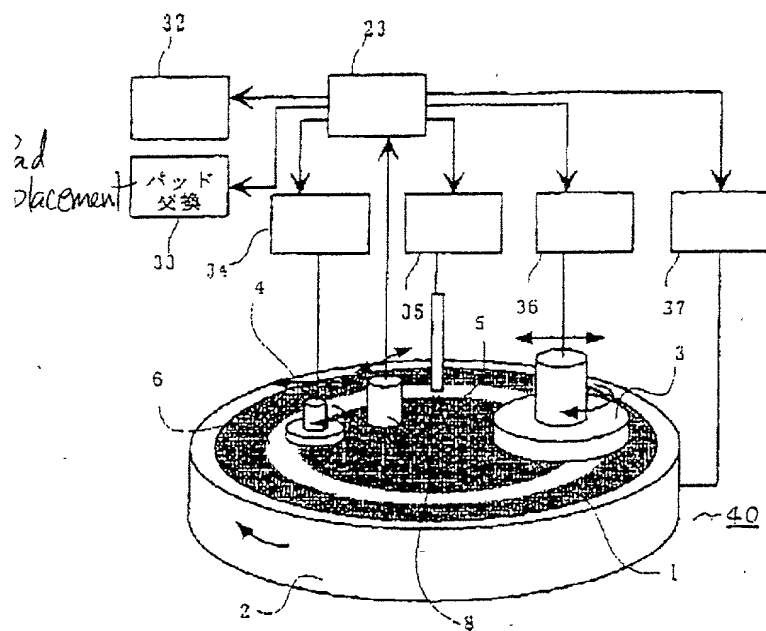
【図 8】



【図 9】



10

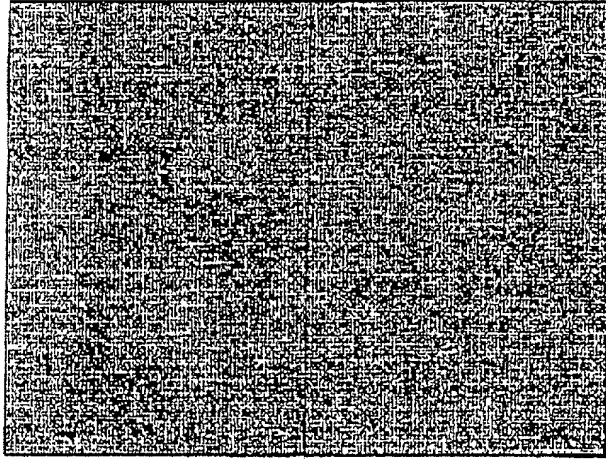


ファイル名 = D99008471A1.e1

【図 1 1】

図 1 1

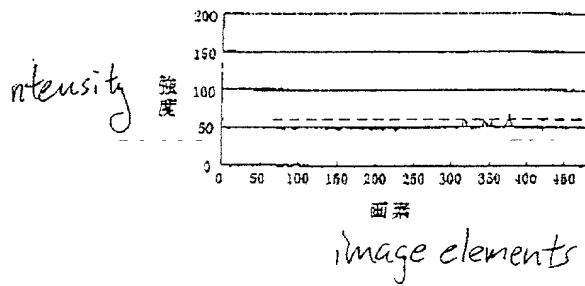
A



A

【図 1 2】

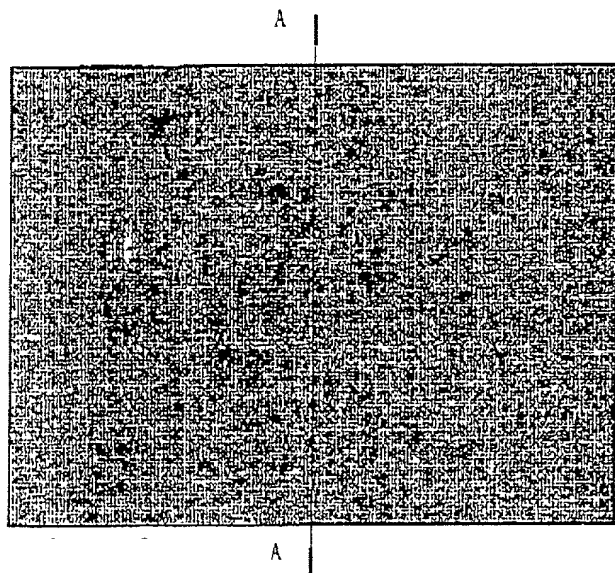
図 1 2



ファイル名 = D99008471Ai.el

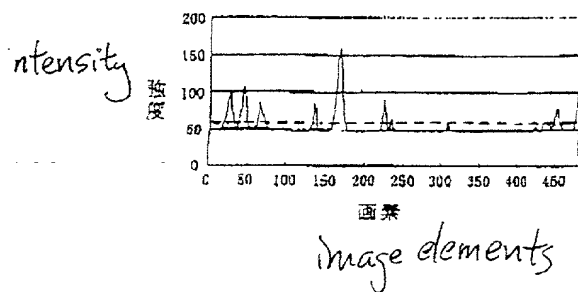
【図 1 3】

図 1 3



【図 1 4】

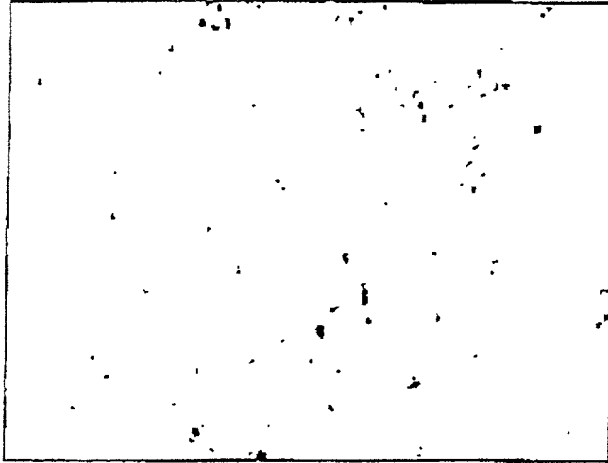
図 1 4



ファイル名 = D99008471A1.el

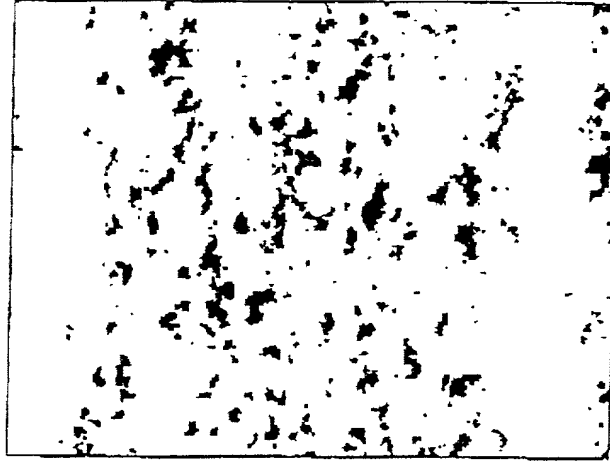
[15]

15



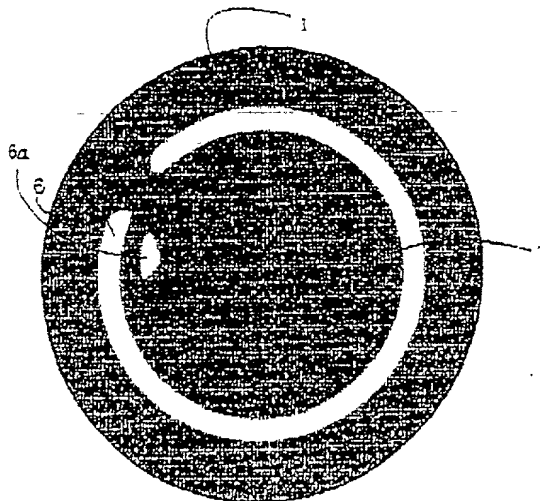
(図 16)

図 16

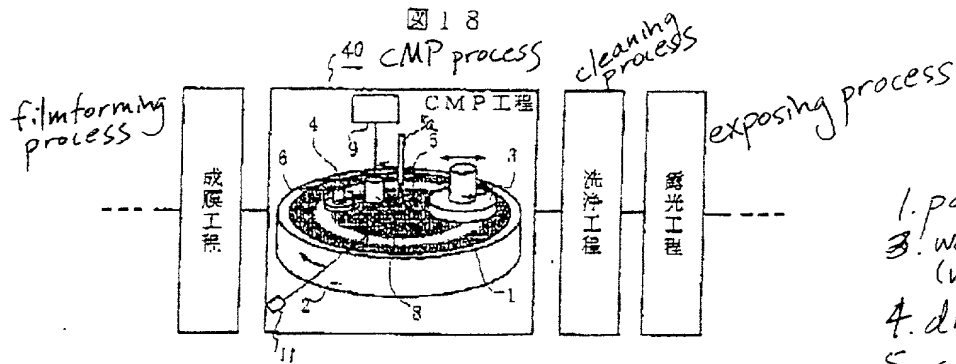


(図 17)

図 17



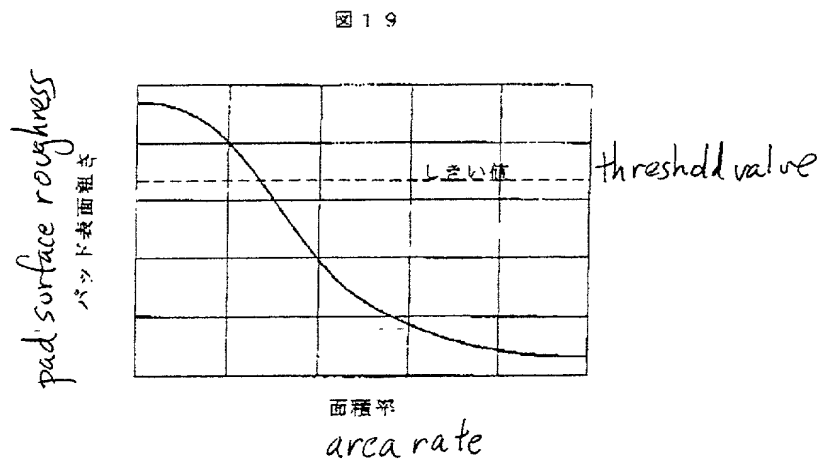
【図18】



- 1...パッド、
 2...ウェハチャック (ウェハ図示せず)
 3...スラリー、
 4...パッドの同心円状劣化部分、
 5...信号処理部、
 6...研磨盤、
 7...ドレッサー、
 8a...研磨液 (スラリー) の供給ノズル、
 9...検出器、
 10...光源

1. pad 2. abrasive
 3. water chuck
 (wafer not shown)
 4. dresser
 5. slurry
 5a: abrasive fluid (slurry)
 supply nozzle
 6: concentric wear on
 pad
 8: detector
 9: signal processor
 11: light source

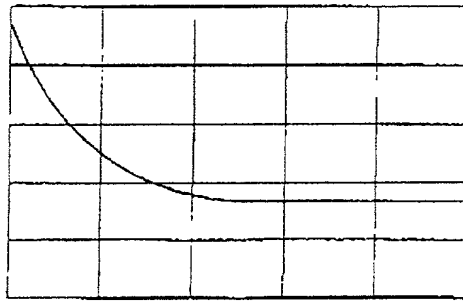
【図19】



【図 20】

optimal dressing pressure
最適ドレッシング圧力

図 20



パッド表面粗さ
pad surface roughness